



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: KDHJ2413360

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	无锡华润上华科技有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡士路		
联系人	徐铭毅	联系电话	18861813800
采样日期	2024-11-14~2024-11-15、 2024-11-20~2024-11-22	分析日期	2024-11-14~2024-11-23
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1。		
<div>编制：丁玉清</div> <div>审核：邵娇娇</div> <div>签发：孙爱平</div> <div>检测机构检验章</div> <div>签发日期：2024 年 12 月 16 日</div> <div></div>			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.1	21.2	21.1	21.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		39520	39062	37719	38767	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.23	ND	0.28	0.20	5.0
	排放速率（kg/h）	7.8×10 ⁻³				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.2	21.3	20.7	21.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		39041	37873	40495	39136	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.09	0.83	1.08	1.00	10
	排放速率（kg/h）	0.039				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.1	21.2	20.7	21.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		39520	39041	40495	39685	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	0.4	0.2	5.0
	排放速率（kg/h）	7.9×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-006 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.1	20.9	20.9	21.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		12705	12454	12712	12624	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-005 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.6	20.7	20.8	20.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		13507	13241	12977	13242	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-016 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.9	19.4	19.5	19.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		19780	20076	19813	19890	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	0.25	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-017 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.9	20.2	20.2	20.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		19972	20282	20285	20180	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-011 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.6	20.9	20.6	20.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		15322	15560	15315	15399	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-049 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		26.9	27.8	28.7	27.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		1537	1531	1706	1591	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.64	0.52	1.88	1.01	10
	排放速率（kg/h）	1.6×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-10 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-050 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		30.4	30.2	29.6	30.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		1072	893	985	983	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		27.7	27.8	25.9	27.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		2387	2439	2516	2447	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	最大值	排放限值
烟气温度（℃）		28.9	29.6	25.9	/	/
标态烟气量（Nm³/h）		2261	2300	2516	/	/
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
	排放量（kg/h）	/	/	/	/	1.8
臭气浓度	无量纲	26	35	30	35	15000
备注	1、排放限值：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 限值。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.008mg/m³（采样体积以 9L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-13 固定污染源废气检测结果表（11 月 14 日）

点位名称		FQ-021 废气排气筒		排气筒高度（m）		25
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.9	23.2	23.4	23.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		6684	6999	6824	6836	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.51	0.69	0.61	0.94	10
	排放速率（kg/h）	6.4×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-14 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.8	18.6	18.5	18.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		45119	44211	44141	44490	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.48	0.46	0.33	0.42	5.0
	排放速率（kg/h）	0.019				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.82	0.99	0.56	0.79	10
	排放速率（kg/h）	0.035				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-15 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.4	18.3	18.3	18.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		43376	44965	42052	43464	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.33	0.40	0.44	0.39	1.5
	排放速率（kg/h）	0.017				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-16 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.8	18.5	18.3	18.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		45119	44141	42052	43771	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	0.2	1.0	ND	0.4	5.0
	排放速率（kg/h）	0.018				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.9	18.1	17.6	18.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		49027	47302	48522	48284	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.23	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-18 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.4	17.0	17.2	17.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		49366	48266	47871	48501	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.31	ND	ND	0.12	1.5
	排放速率（kg/h）	5.8×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-19 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		17.4	17.0	17.0	17.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		49366	48266	48266	48633	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.34	1.02	1.11	0.82	10
	排放速率（kg/h）	0.040				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-20 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.9	18.1	17.0	18.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		49027	47302	48266	48198	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-21 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.2	16.2	16.4	16.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		26143	28276	30360	28260	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.30	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	1.19	1.52	1.14	1.28	10
	排放速率（kg/h）	0.036				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-22 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.6	16.7	16.6	16.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		34852	32160	29874	32295	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	1.36	1.22	0.86	1.15	1.5
	排放速率（kg/h）	0.037				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-23 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.2	16.6	16.6	16.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		26143	34852	29874	30290	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	0.4	0.5	0.7	0.5	5.0
	排放速率（kg/h）	0.015				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、氯气均值为三小时均值。					

表 1-24 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.6	16.2	16.5	16.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		26201	22106	25374	24560	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-25 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.4	16.5	17.0	16.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		24815	26998	25762	25858	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.11	0.24	0.49	0.28	1.5
	排放速率（kg/h）	7.2×10 ⁻³				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.76	1.02	0.67	0.82	10
	排放速率（kg/h）	0.021				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-26 固定污染源废气检测结果表（11 月 15 日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.6	16.5	17.0	16.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		26201	25374	25762	25779	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	0.6	ND	ND	0.3	5.0
	排放速率（kg/h）	7.7×10 ⁻³				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-27 固定污染源废气检测结果表（11 月 20 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.7	18.7	18.7	18.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		28842	29647	30857	29782	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-28 固定污染源废气检测结果表（11 月 20 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.7	18.7	18.8	18.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		31288	31440	31183	31304	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.16	0.38	0.16	0.23	1.5
	排放速率（kg/h）	7.2×10 ⁻³				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.42	0.56	0.88	0.62	10
	排放速率（kg/h）	0.019				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-29 固定污染源废气检测结果表（11 月 20 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.7	18.7	18.8	18.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		28842	30857	31183	30294	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-30 固定污染源废气检测结果表（11 月 20 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.9	18.8	18.8	18.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		33246	36525	33536	34436	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	0.77	ND	0.32	5.0
	排放速率（kg/h）	0.011				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	1.98	ND	1.10	1.06	10
	排放速率（kg/h）	0.037				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氯化氢的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 10L 计）。					

表 1-31 固定污染源废气检测结果表（11 月 20 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.7	18.6	18.6	18.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		35920	34585	33459	34655	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.17	0.20	0.07	0.15	1.5
	排放速率（kg/h）	5.2×10 ⁻³				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-32 固定污染源废气检测结果表（11 月 20 日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.9	18.8	18.6	18.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		33246	33536	33459	33414	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-33 固定污染源废气检测结果表（11 月 21 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.3	19.3	19.3	19.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		26382	27009	25723	26371	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.72	0.87	0.59	0.73	5.0
	排放速率（kg/h）	0.019				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.59	0.41	0.54	0.51	10
	排放速率（kg/h）	0.013				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-34 固定污染源废气检测结果表（11 月 21 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.1	18.7	18.7	18.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		25972	23054	25702	24909	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	0.22	0.17	0.14	1.5
	排放速率（kg/h）	3.5×10 ⁻³				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-35 固定污染源废气检测结果表（11 月 21 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.3	19.3	18.7	19.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		26382	25723	25702	25936	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-36 固定污染源废气检测结果表（11 月 22 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.8	19.3	19.3	19.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		29187	28624	28480	28764	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	0.57	1.08	0.34	0.66	5.0
	排放速率（kg/h）	0.019				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	2.72	0.52	2.30	1.85	10
	排放速率（kg/h）	0.053				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-37 固定污染源废气检测结果表（11 月 22 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.3	19.1	18.8	19.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		29955	29414	30480	29950	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	0.20	0.27	0.24	0.24	1.5
	排放速率（kg/h）	7.2×10 ⁻³				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-38 固定污染源废气检测结果表（11 月 22 日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		18.8	19.3	18.8	19.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		29187	28480	30480	29382	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2007 年 第五篇第四章 十（三）
备注	/

表 3 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-016-19	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-015-11	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
F-001-14	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-010-08	离子色谱仪	883
F-010-06	离子色谱仪	883
F-014-13	离子计	PXSJ-216F
F-001-13	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
X-046-22	数字温度表	6801
X-015-104	阻容法烟气含湿量多功能检测器	1062D 型
X-016-23	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-33	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-015-101	阻容法烟气含湿量多功能检测器	1062D 型
X-060-50	充电便携采气桶	labtm009
X-016-34	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-046-20	数字温度表	6801
X-016-29	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-015-74	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-77	烟气综合分析仪	崂应 3022
X-016-30	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-25	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F-010-15	离子色谱仪	ECO IC
X-015-47	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-016-16	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-015-45	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-016-24	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F-014-03	离子计	PXSJ-216

*****报告结束*****